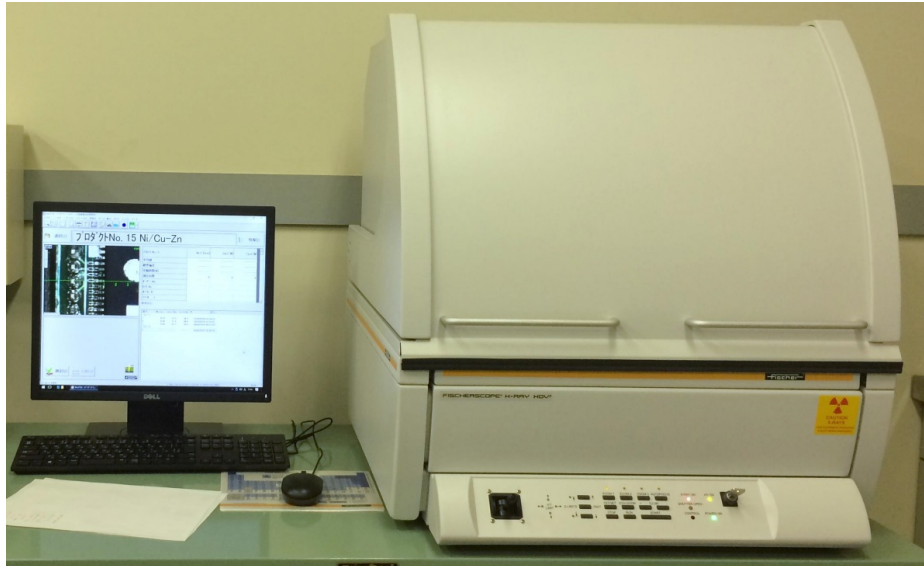


蛍光X線膜厚計



フィッシャー・インストルメンツ株式会社製 XDV-SDD

本装置は、試料にX線を照射し、そのとき放出される特性X線を検出することで、めっきの膜厚を測定する装置です。電解式膜厚計や顕微鏡による断面観察を用いる方法と異なり、試料を非破壊的にかつ短時間（100秒程度）で測定することができます。

本装置は、最小φ0.1mmのコリメータを備えており、微小部分のめっき厚さについても測定が可能なほか、4層以上の多層めっき膜厚測定、合金めっき皮膜の組成分析にも対応しています。

【適用例】

- ・電気亜鉛めっきボルト(鉄素材/電気亜鉛めっき)
- ・金めっき端子(銅素材/ニッケル/金めっき)
- ・金具(亜鉛ダイカスト/銅/ニッケル/クロムめっき)
- ・はんだめっきのPb含有(RoHS・ELV対策)

- ・測定可能試料：測定箇所が水平上面になるように置いたとき、縦250mm×横250mm×高さ140mmの範囲に収まる試料
- ・試料台移動範囲：縦250mm×横250mm×高さ140mm
- ・測定可能元素：原子番号13(Al)～92(U)
- ・依頼試験料金：5,300円/1試料
- ・分析スポット：φ0.1mm、φ0.3mm、φ1.0mm、φ3.0mm
- ・厚さ測定範囲：数十nm～およそ20μmまで(元素による)
- ・装置使用料金：8,500円/半日(指導料別途要)
- ・問い合わせ先：林(2640)、長瀧(2730)